

EELS School 2018 開催のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度「Gatan EELS School」開催のご案内をさせていただきます。

本スクールは、日本ガタンおよび日本電子株式会社の協力のもと、名古屋大学未来材料・システム研究所超高压電子顕微鏡施設主催、微細構造解析プラットフォーム共催として開催いたします。

現在 EELS を使用中のお客様や、更にはご関心・ご興味のある方におかれましても、この機会に是非ご参加ください。

敬具

記

- 日 時： 8月7日（火）～9日（木） 3日間
午前 10：00～12：00 午後 12：45～17：00/17：15
- 会 場： 名古屋大学 未来材料・システム研究所 超高压電子顕微鏡施設
※（別紙地図をご覧ください。）
- 講 師： 日本電子株式会社 奥西 栄治 様（ARM200F/Quantum オペレート実施）
日本ガタン 伊野家 浩司（講義実施）
※ 講義は日本語で実施されますが、資料は英語となります。
- 内 容： 詳細については別紙を参照ください。
- 定 員： 10名（定員に達し次第、申込み終了とさせていただきます。）
- 参加費： 無料
- 宿 泊： 宿泊に関しては各自ご手配をお願いします。
- 申込み方法： 下記より必要事項を入力の上、お申込みください。

アドレス kenbikyo@imass.nagoya-u.ac.jp

※7月2日より受付開始となります。

※誠に申し訳ございませんが、定員に限りがございます為、受付が可能かどうかのご連絡をさせていただきますのでお待ち頂けますようお願い申し上げます。

- 本件担当： 山本悠太 E-mail: y.yamamoto@imass.nagoya-u.ac.jp
Tel: 03-789-3631 Fax: 03-789-3174

概略スケジュール（内容は一部変更される場合があります）

※装置実習も含まれます。Computer Session と TEM Session は2つの Gr に分かれます。

使用装置: ARM200F(日本電子製)及び Quantum965(Gatan)

PCにて Digital Micrograph 使用 (GMS3)

8月7日(火)

Lecture 1: EELS in the TEM: An Introduction

Lecture 2: Information from the EELS spectrum

Lecture 3: Practical EELS and STEM EELS SI

TEM Lab 1 (Group 1) : Hands on operation - Spectrometer tuning and EELS acquisition

TEM Lab 1 (Group 2) : Hands on operation - Spectrometer tuning and EELS acquisition

8月8日(水)

Lecture 4: EFTEM and EFTEM-SI Applications : Introduction to EFTEM

Lecture 5: Practical EFTEM and EFTEM-SI

Lecture 6: EELS Quantification

TEM Lab 2 (Group 1) : Hands on operation - EFTEM acquisition

TEM Lab 2 (Group 2) : Hands on operation - EFTEM acquisition

TEM Lab 3 (Group 1) : Hands on operation - EFTEM / EFTEM-SI acquisition

TEM Lab 3 (Group 2) : Hands on operation - EFTEM / EFTEM-SI acquisition

8月9日(木)

Lecture 7: STEM EELS Acquisition and Optimization

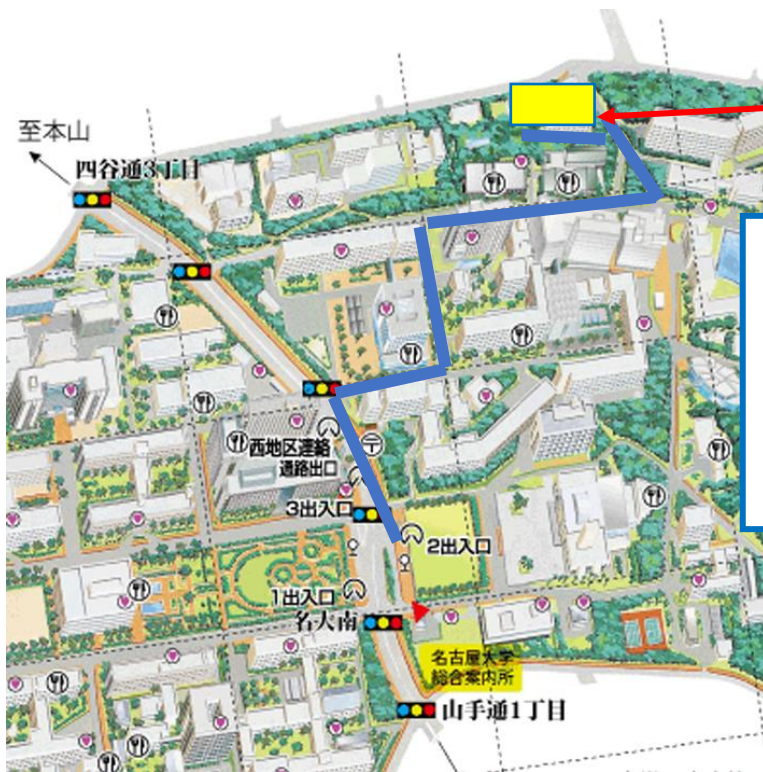
Lecture 8: Advanced EELS Analysis Techniques

TEM Lab 4 (Group 1) : Hands on operation - STEM EELS-SI acquisition

TEM Lab 4 (Group 2) : Hands on operation - STEM EELS-SI acquisition

TEM Lab 5 (Group 1) : Hands on operation - STEM-EELS optimization

TEM Lab 5 (Group 2) : Hands on operation - STEM-EELS optimization



超高压電子顕微鏡施設

名古屋大学 未来材料・システム研究所
 超高压電子顕微鏡施設
 〒464-8603
 愛知県名古屋市千種区不老町
 TEL. 052-789-3632
 FAX. 052-789-3174

<住所> 〒464-8603 愛知県名古屋市千種区不老町 名古屋大学 未来材料・システム研究所 超高压電子顕微鏡施設



地下鉄名城線 名古屋大学駅下車徒歩5分

<JR名古屋駅・名鉄新名古屋駅・近鉄名古屋駅からの場合>

地下鉄東山線藤が丘行きに乗車し、本山駅で地下鉄名城線右回りに乗り換え、名古屋大学駅下車。所要時間約30分(乗換含)

<JR金山駅・名鉄金山駅からの場合>

地下鉄名城線左回りに乗車し、名古屋大学駅下車。所要時間約25分



中部国際空港を利用

空港から名鉄特急に乗車し、名古屋駅または金山駅で下車、その後地下鉄に乗り換え(下図参照)

又は、空港バスにて栄または名古屋駅に出て、地下鉄に乗り換え。(下図参照)

以上